

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (大企業) *1

※2026年4月1日更新

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用 (データ提供あり) *2			ARIM利用 (データ提供なし)			非公開利用 (NOF利用)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥30,500	¥38,500	¥46,500	¥58,000	¥74,000	¥90,000	¥75,400	¥96,200	¥117,000
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥19,500	¥27,500	¥35,500	¥36,000	¥52,000	¥68,000	¥46,800	¥67,600	¥88,400
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
7	マスクレス露光装置 [DL-1500IS2]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
8	HMD5ベーク処理装置 [APPS-30]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
9	自動現像装置 [AD-1200]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
11	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
12	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
13	蒸気二流体洗浄装置 [SSM101]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
14	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
16	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
17	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
18	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
20	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
21	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
22	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
23	原子層堆積装置 [TFS200]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
24	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
25	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
26	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
27	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
28	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
29	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
30	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
31	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
33	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
34	イオンビームミリング複合装置 [16IBE]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
36	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
37	FE-SEM [S-4800]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
38	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
39	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
40	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥32,500	¥53,300	¥74,100
41	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
42	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
43	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
45	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
46	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
47	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
48	分光エリブソメーター [M2000]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
49	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
50	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
51	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
52	ダイシングソー [DAD322]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
53	ダイシングソー [DAD3220]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
54	室温プローバー [MX-200/B]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
55	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
56	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
57	ウェットステーション	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
58	CAD (描画データ) 作成システム	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800
59	クリーンルーム設備	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥14,000	¥30,000	¥46,000	¥18,200	¥39,000	¥59,800

*1 大企業：資本金1億円超の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価(税抜)であり、これに利用時間(※)を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
 - ロッカー等を定期的に使用(占有)する場合は、クリーンルーム設備の利用として課金します。
 - 成膜装置で金(Au)を成膜する場合は、膜厚に応じたAu使用料を課金します。
- ※ 利用時間は、装置予約時間 (= 装置占有時間: 装置の立ち上げ/終了作業時間含む) です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (中小企業) *1

※2026年4月1日更新

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用 (データ提供あり) *2			ARIM利用 (データ提供なし)			非公開利用 (NOF利用)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥25,000	¥31,400	¥37,800	¥30,500	¥38,500	¥46,500	¥39,650	¥50,050	¥60,450
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥16,200	¥22,600	¥29,000	¥19,500	¥27,500	¥35,500	¥25,350	¥35,750	¥46,150
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
7	マスクレス露光装置 [DL-1500iS2]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
8	HMDSベーク処理装置 [APPS-30]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
9	自動現像装置 [AD-1200]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
11	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
12	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
13	蒸気二流体洗浄装置 [SSM101]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
14	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
16	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
17	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
18	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
20	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
21	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
22	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
23	原子層堆積装置 [TFS200]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
24	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
25	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
26	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
27	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
28	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
29	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
30	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
31	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
33	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
34	イオンビームミリング複合装置 [16IBE]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
36	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
37	FE-SEM [S-4800]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
38	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
39	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
40	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥11,800	¥18,200	¥24,600	¥14,000	¥22,000	¥30,000	¥18,200	¥28,600	¥39,000
41	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
42	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
43	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
45	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
46	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
47	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
48	分光エリブソメーター [M2000]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
49	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
50	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
51	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
52	ダイシングソー [DAD322]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
53	ダイシングソー [DAD3220]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
54	室温プローバー [MX-200/B]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
55	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
56	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
57	ウェットステーション	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
58	CAD (描画データ) 作成システム	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850
59	クリーンルーム設備	¥7,400	¥13,800	¥20,200	¥8,500	¥16,500	¥24,500	¥11,050	¥21,450	¥31,850

*1 大企業：資本金1億円超の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価 (税抜) であり、これに利用時間 (※) を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
 - ロッカー等を定期的に使用 (占有) する場合は、クリーンルーム設備の利用として課金します。
 - 成膜装置で金 (Au) を成膜する場合は、膜厚に応じたAu使用料を課金します。
- ※ 利用時間は、装置予約時間 (= 装置占有時間: 装置の立ち上げ/終了作業時間含む) です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (スタートアップ企業・アカデミア) *1

※2026年4月1日更新

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用 (データ提供あり) *2			ARIM利用 (データ提供なし)			非公開利用 (NOF利用)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥14,000	¥17,200	¥20,400	¥19,500	¥24,300	¥29,100	¥25,350	¥31,590	¥37,830
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥9,600	¥12,800	¥16,000	¥12,900	¥17,700	¥22,500	¥16,770	¥23,010	¥29,250
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
7	マスクレス露光装置 [DL-1500iS2]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
8	HMDSベーク処理装置 [APPS-30]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
9	自動現像装置 [AD-1200]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
11	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
12	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
13	蒸気二流体洗浄装置 [SSM101]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
14	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
16	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
17	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
18	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
20	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
21	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
22	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
23	原子層堆積装置 [TFS200]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
24	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
25	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
26	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
27	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
28	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
29	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
30	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
31	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
33	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
34	イオンビームミリング複合装置 [16IBE]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
36	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
37	FE-SEM [S-4800]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
38	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
39	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
40	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥7,400	¥10,600	¥13,800	¥9,600	¥14,400	¥19,200	¥12,480	¥18,720	¥24,960
41	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
42	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
43	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
45	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
46	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
47	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
48	分光エリブソメーター [M2000]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
49	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
50	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
51	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
52	ダイシングソー [DAD322]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
53	ダイシングソー [DAD3220]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
54	室温プローバー [MX-200/B]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
55	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
56	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
57	ウェットステーション	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
58	CAD (描画データ) 作成システム	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670
59	クリーンルーム設備	¥5,200	¥8,400	¥11,600	¥6,300	¥11,100	¥15,900	¥8,190	¥14,430	¥20,670

*1 大企業：資本金1億円超の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 1, 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価 (税抜) であり、これに利用時間 (※) を乗じます。
 - 2, 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 3, 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 4, 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 5, 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 6, 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
 - 7, ロッカー等を定期的に使用 (占有) する場合は、クリーンルーム設備の利用として課金します。
 - 8, 成膜装置で金 (Au) を成膜する場合は、膜厚に応じたAu使用料を課金します。
- ※ 利用時間は、装置予約時間 (= 装置占有時間: 装置の立ち上げ/終了作業時間含む) です。